

# 研究設備センター装置

装置名(規格)	管理責任者 担当者
<b>表面・界面構造解析室</b>	<b>室長 中村 仁</b>
X線光電子分析装置(日本電子(株)、JPS-9200)	桑原 大介 小林 利章
結晶方位分散分析走査電子顕微鏡(日立(株)、S-4300/EBSD)	桑原 大介 木村 誠二
温度可変超高真空原子間力顕微鏡(Omicron、VT・AFM)	桑原 大介
200kV熱電子放出型透過型電子顕微鏡(日本電子(株)、JEM-2010)	桑原 大介 木村 誠二
200kV電界放出型透過型電子顕微鏡(日本電子(株)、JEM-2100F)	桑原 大介 木村 誠二
電子線元素状態分析装置(日本電子(株)、JXA-8530F)	中村 仁
<b>化学構造解析室</b>	<b>室長 安井 正憲</b>
超伝導フーリエ変換NMR(500MHz)(日本電子(株)、ECA-500)	平野 誉
LCQイオントラップ型質量分析計(Thermo Scientific社、)	瀧 真清
超伝導フーリエ変換NMR(300MHz)(Varian社、Unity-300)	桑原 大介
円二色性分散計(日本分光(株)、J-720W)	安井 正憲
二重収束質量分析計(EI,FAB,GC/MS)(日本電子(株)、JMS-600)	平野 誉
熱分析装置((株)リガク、DSC8230・TG8120)	安井 正憲
CCD型単結晶X線回折装置((株)リガク、Saturn70 CCD)	安井 正憲
HPC 型単結晶 X 線回折装置	安井 正憲
DSC粉末X線同時測定装置((株)リガク、Ultima III)	安井 正憲
精密構造解析用X線回折装置((株)リガク、)	安井 正憲
ESI - TOF型質量分析装置(日本電子(株)、JMS-T100 AccuTOF)	平野 誉
有機元素分析装置(PerkinElmer、Series II CHNS/O 2400)	石田 尚行
共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡(カールツァイス、LSM710) 凍結マイクローム CM1950	白川 英樹
高速液体クロマトグラフィーシステム(バイオ・ラッド(株)、NGC Quest 10 plus)	三瓶 厳一
<b>分析・計測機器室</b>	<b>室長 石田 尚行</b>
最先端三次元形状測定・評価システム(ZEISS PRISMO Navigator 5 S-ACC mass)	金森 哉吏
超伝導量子干渉型磁束計 (Quantum Design社、MPMS-XL7)(Quantum Design社、MPMS-5)(MPMS3)	石田 尚行
電子スピン共鳴装置(Bruker 社、ESP300E 9/2.7)	石田 尚行
高磁場多目的物性測定システム(Quantum Design社、PPMS)	石田 尚行
高速応答FT-IR(Thermo Scientific社、Nicolet 6700)	桑原 大介
顕微レーザーラマン分光計(日本分光(株)、NRS3100)	桑原 大介
マクロフォトルミネッセンス装置(堀場製作所、)	内田 和男 田尻 武義
温度可変ホール測定装置(ケースレー社、)	内田 和男 田尻 武義
電磁環境測定装置(電波暗室)(TDK-EPC(株)、(株)デバイス、Agilent Tech.(株))	木寺 正平
絶対PL量子収率測定装置(浜松フォトニクス、Quantaurus-QY)	平野 誉
フラッシュ法熱物性測定装置(Bruker AXS、NETZSCH LFA447 NanoFlash)	白川 晃
示差走査熱量計(NETZSCH DSC3500)	白川 晃
無響室	野村 英之
最先端材料特性評価システム	松村 隆
<b>低温室</b>	<b>室長 島田 宏</b>
34. ヘリウム液化システム (Linde社、ヘリウム液化機 他)	島田 宏 小林 利章